

(11)Publication number:

03-287222

(43)Date of publication of application: 17.12.1991

(51)Int.CI.

## G02B 26/10

(21)Application number: 02-088903

(71)Applicant:

RICOH CO LTD

(22)Date of filing: 03.04.1990 (72)Inventor:

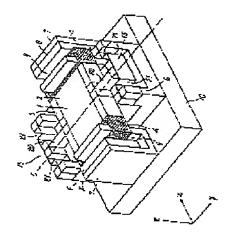
KIBUNE HIDEAKI

## (54) TRACKING MIRROR ACTUATOR DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To make the primary resonance frequency of support spring members low and to reduce variance in the primary resonance frequency due to variance in plate thickness by providing support spring members, which support a movable part, with a torsional spring part which twists around a center line of rotation and a bending part which bends in the direction of the center line of rotation.

CONSTITUTION: This device is equipped with the right-left symmetric movable part 1 which has a mirror 2, a mirror support 3, and a driving part 4 and a couple of support spring members 15 which support the movable part 1 freely rotatably. Then the support spring parts 15 are provided with the torsion spring part 20 which can twist to deform around the center axis of rotation of the movable part 1 and the bending part 21 which can bends in the direction of the center axis of rotation, and the torsion spring part 20 is supported by the bending part 21 movably in the direction of the center axis of rotation. Consequently, even when the plate thickness of the torsion spring part 20 is made large, the primary resonance frequency becomes sufficiently low and the variance in primary resonance frequency due to the variance in plate thickness becomes small.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

@特許出願公開

## ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-287222

fint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)12月17日

G 02 B 26/10

人

104 A

8507-2K

**会公时** 上於2十(1991)12月11日

275 00

審査請求 未請求 請求項の数 2(全10頁)

❷発明の名称

**勿出 顧** 

トラツキングミラーアクチュエータ装置

**ወ特 願 平2-88903** 

❷出 願 平2(1990)4月3日

**@** 発 明 者 木 船 英 明

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

10代理人 弁理士樺山 亨 外1名

株式会社リコー

明 細 書

#### 発明の名称

トラッキングミラーアクチュエータ装置 特許請求の範囲

して情報の記録・再生を行う光情報記録再生装置において上記光スポットのトラッキング動作を行うために用いられるトラッキングミラーアクチュエータ装置であって、ミラーとミラー支 特体と駆動部とを有するほぼ左右対称な可動部

1. 光情報記録媒体上に微小な光スポットを形成

と、該可助部の左右両側から可動部の回転中心 額に沿って延出するように設けられ可動部を回 助自在に支持する一対の支持ばね部材とを備え、 上記可動部を上記鹿動部により廻動させること によって上記光情報記録媒体上の光スポットに トラッキング動作を行わせるようにしたトラッ

上記支持パネ部材は、上記可動部の回転中心 頼を中心にねじり変形可能なねじりばね部と、 回転中心軸方向に屈曲可能な屈曲部を有し、上

キングミラーアクチュエータ装置において、

記ねじりばね部の一葉は上記風曲部により回転中心動方向に移動可能に支持されるとともに、 上記ねじりばね部の厚み方向を上記ミラーの反 射面内方向に合わせて設けたことを特徴とする トラッキングミラーアクチュエータ装置。

2. 光情報記録媒体上に微小な光スポットを形成 して情報の記録・再生を行う光情報記録を再生装 置において上記光スポットのトラッキング動作 を行うために用いられるトラッキングミラーア クチュエータ装置であって、ミラーと 特体と駆動部とを有するほぼ左右対称なの回 大と、鉄可動部の左右方側からの可転の回転の はに沿って延出する一対の支持ばねの前の回 動自在に支持する一対の支持ばね部をは 上記可動部を上記駆動部により回動をせること によって上記光情報記録媒体上の光スポット ラッキング動作を行わせるようにしたトラッキングミラーアクチュエータ装置において、

上記一対の支持ばね部材は、夫々上記可勤部の回転中心戦と同一直線上に中心線を有する聲

- 1 -

—145*—*-

- • -

板状のばね部材からなり、この可動部左右の一対の支持ばね部材は回転中心軸を中心に微小角度だけ同方向にねじりを加えられた状態で両端を失々固定されていると共に、上記一対の支持ばね部材の厚み方向は上記ミラーの反射面内方向に合わせて設けられていることを特徴とするトラッキングミラーアクチュエータ装置。

#### 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は、光ディスクドライブ装置等の光ピックアップに装備されるトラッキングミラーアクチュエータ装置に関する。

## (従来の技術)

光ディスクドライブ装置や光磁気ディスクドライブ装置等の光情報記録再生装置において、光情報記録体上に集光された光スポットの精密位置制御を行うために、光ピックアップには光スポットのトラッキング動作を行うためのトラッキングミラーアクチュエータ装置が設けられているが、このトラッキングミラーアクチュエータ装置とし

- 3 -

#### 9回を参照して説明する。

第8回及び第9回において、可動部1は、ミラー2とミラー支持体3と2つの駆動コイル4とから構成されている。この可動部1を支持する2つの支持ばね5は、失々一端をミラー支持体3に、位端を基台10何の固定部支持体6に固定されている。可動部1のミラー支持体3の両何に固定された駆動コイル4の中には、基台10何に固定された磁気回路のヨーク7の一端が挿入され、磁石8とヨーク7の形成する磁気ギャップ9の中に駆動コイル4の一辺が位置している。

また、上記支持はね5は、可動部1の両側に対称に設けられており、可動部1両側の支持はね5の中心線は同一直線Cの上にあり、この直線Cは、可動部1の回転中心となっている。また、可動部1の重心は直線Cの近傍に位置している。

さて、以上のような構成からなるトラッキング ミラーアクチュエータ装置において、磁気ギャップ8の中の駆動コイル4に発生するミラー法験方 肉(図中ェ方向)の力の向きが、失々のコイルで ては、例えば、特別昭62-210418号公保記載のも のなどが知られている。

上記公報記載のトラッキングミラーアクチュエータ装置では、ミラーとミラー支持体とを含む可動部を左右2つの存板状のばね部材で支持し、この支持ばね部材のねじり中心線上近傍に可動部の重心を設けると共に、支持系の低解性の方向がミラー面内方向となり、高駆性の方向がミラー 法集方向となるように、上記支持ばね部材の厚み方向をミラー面内方向に合わせて固定している。

したがって、このトラッキングミラーアクチュエータ版匠では、ミラー面内でミラーが微小量移動しても光ビームの位置には全く影響しないため、 支持系が低期性であっても問題はなく、光ビームの位置に関係するミラー独縁方向の支持系開性は 高型性とすることができるため、光スポットの位置決め特度を低下させる扱動を抑制することができる。

ここで、上記従来のトラッキングミラーアクチ ュエータ装置の具体的な例について第8図及び第

- 4 -

反対となるように電流の向きを決定することにより、可動部1を直縁Cを中心として回転させる成 気的傷力が発生する。

ここで、支持はね5の回転中心Cと可動部1の 重心とが一致し、両端の駆動コイル4で発生する 正、負の力の大きさが一致している場合、可動部 1には直線Cを中心とする回転運動しか発生しない。

しかしながら、一般に、回転中心Cと可助部1の置心にはずれが生じ、2つの配動コイル4で発生する力も同じ大きさではない。また、可動部1両側の支持ばね5も、形状、材料特性に生じるずれが避けられない。したがって、これらの影響により、可動部1には、直線C回りの回転の他に、x,y,z方向の直逸運動及びx,z韓回りの回転運動が発生する。

そこで、上記位来技術では、支持ばね5の厚み方向が、ミラー2の面内方向となるように固定している。すなわ、支持ばね5は、長手方向(y方向)と巾方向(z方向)の原性は十分大きいため、

2方向、y方向の直進運動、及びx 韓回りの回転 運動の変位は、十分小さくなる。

また、支持ばね5の厚み方向(×方向)の関性 は小さいため、×方向の直逃運動、及びェ韓回り の回転運動の変位は大きくなるが、ミラー2がミ ラー面内で移動、回転しても、ミラー2で反射さ れた光束の位置及び角度は変化しないため、無視 することができる。

## (発明が解決しようとする課題)

ところで、上記使来のトラッキングミラーアクチュエータ装置においては、可動部1の一次共振周波数は通常50日 z 前後に設定する必要があるため、例えば支持は45の材質にステンレスを使用した場合、板厚を20μm前後と大変薄くの回れた場合、大変がある。これた場合、長手方向(図中ッ方は、立若干縮まってしまうのに対し、支持は45に成まりに、位縮を3ラー支持体3に、位縮を3ラー支持体3に、位縮を10に対けた6にである。このため、一般的な片符ち

- 7 -

ことができれば、板厚のパラツキの影響は小さくなり、一次共振周紋数のパラツキを低級することができるが、第8回、第9回に示す従来装置の構成のままで支持ばね部材5の板厚を厚くした場合、一次共超周波数を50Hz前役にするためには、支持ばね部材5の長手方向(y方向)の及さを極端に長くするか、あるいは、支持ばね部材5の巾方向(z方向)の長さを極端に短くせざるおえない。

しかしながら、支持ばね部材5の長手方向(y方向)の長さを極端に長くした場合、装置が大型化してしまうという同駆が生じ、また、支持ばね部材5の中方向(z方向)の長さを極端に短くした場合、可動部1の回転により支持ばね部材5に作用する剪断応力(kgf/dd)が過大になり、支持ばね部材の許容応力を越えてしまうという問題がある。

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであっ て、一次共振局被数を良好に低減することができ、 且つ一次共振周被数のパランキをも低減しうるよ のねじりばねに比べて大変ばね定数が高くなって しまう。

ところで、ステンレス領板は、製造上その厚さ に対して±2μm程度の製差が避けられないため、 ステンレス領板を支持ばねに使用した場合、支持 ばね5の板厚は±10%程度のパランキを持つこ とになる。

ここで第8回に示す構成のトラッキングミラーアクチュエータ数量の場合、支持ばね5のねじりばね定数は板厚の3乗に比例し、一次共振周波数はばね定数の1/2乗に比例するため、例えば、板厚が±10%のパラツキを持つと、一次共振周波数は±15%程度のパラツキを持つことになる。

一般に、トラッキングミラーアクチュエータ装置の制御系の仕様を考慮すると、可動部1の一次 共扱間波数は±10%の範囲にある必要があり、 したがって、上述の従来装置の構成では一次共振 周波数のパランキが大きくなりすぎており、制御 系の仕様を満足することはできない。

ところで、支持ばね部材5の板厚を大きくする

- 8 -

うにしたトラッキングミラーアクチュエータ装置 を提供することを目的とする。

### [無額を解決するための手段]

上記目的を達成するため、本発明の第1の構成 では、ミラーとミラー支持体と鹿動部とを有する ほぼ左右対称な可動部と、該可動部の左右両側か ら可動部の回転中心軸に沿って延出するように設 けられ可動部を回動自在に支持する一対の支持は ね部材とを備え、上記可動部を上記収動部により 回動させることによって上記光情報記録媒体上の 光スポットにトラッキング動作を行わせるように したトラッキングミラーアクチュエータ装置にお いて、上記支持ばね部材は、上記可動部の回転中 心輪を中心にねじり変形可能なねじりばね部と、 回転中心動方向に屈曲可能な屈曲部を有し、上記 ねじりばね然の一葉は上記風曲盤により回転中心 動方向に移動可能に支持されるとともに、上記ね じりばね部の厚み方向を上記ミラーの反射面内方 向に合わせて負けたことを終徴とする。

また、上記目的を達成するため、本発明の第2

の 成では、ミラーとミラー女枠体と駆動部とを 有するほぼ左右対称な可動部と、誠可動部の左右 両個から可動館の回転中心軸に沿って延出するよ うに設けられ可動部を回動自在に支持する一対の 支持ばね部材とを備え、上記可動部を上記駆動部 により回動させることによって上記光情報記録媒 体上の光スポットにトラッキング動作を行わせる ようにしたトラッキングミラーアクチュエータ教 置において、上記一対の支持ばね部材は、夫々上 記可動部の回転中心軸と同一直線上に中心線を有 する存板状のばね節材からなり、この可効部左右 の一対の支持ばね部材は回転中心軸を中心に微小 角度だけ同方向にねじりを加えられた状態で両端 を失々固定されていると共に、上記一対の支持ば ね部材の厚み方向は上記ミラーの反射面内方向に 合わせて設けられていることを特徴とする。

#### (作用)

本発明の第1の構成によるトラッキングミラー アクチュエータ装置においては、可動部を支持す る支持はね部材に、回転中心線を中心にねじれる

- 11 -

ータ装置の良好な制御が可能となる。 (実 流 例)

以下、本発明の実施例について図面を参照して 詳細に説明する。

第1図は本発明の第1の構成の一実施例を示すトラッキングミラーアクチュエータ装置の斜視構成図、第2図(a)は阿上トラッキングミラーアクチュエータ装置の支持ばね都材を図中ェ方向より見た状態を模式的に示す平面図、第2回(b)は第2図(a)の『一 II 線断面図である。

第1回及び第2回において、このトラッキングミラーアクチュエータ装置の可動部1は、ミラー2とミラー支持体3と2つの駆動コイル4とから移成されている。この可動部1の左右関便を夫々支持する2つの支持ばね部材15は、央々一幅をミラー支持体3に、他端を基台10何の固定部支持体6に固定されている。可動部1のミラー支持体3の両側に固定された方形状の駆動コイル4の中には、基台10何に固定された磁気回路のコ字型形状をしたヨーク7の一幅例が挿入されており、

ねじりばね部と、回転中心はの方向に曲がる屈曲 部とを設けることにより、上記ねじりばね部の一 縮側は上記屈曲郎の作用により回転中心線方向に 移動可能となり、上記支持ばね部材のねじりばね 部の板厚を厚くしても一次共協周被数を低くでき、 板厚のパラツキによる一次共協周被数のパラツキ も少なくすることができ、トラッキングミラーア クチュエータ装置の良好な制御が可能となる。

また、本発明の第2の構成によるトラッキングミラーアクチュエータ装置においては、可動部左右の一対の支持ばね部材は関転中心執を中心に横小角度だけ両方向にねじりを加えられた状態で両端を可動部と固定部とに夫々固定されているため、可動部の回転によりねじれが生じたときにも、各支持ばね部材は組み、他方の支持ばね部材は組み、他方の支持ばね部材は組み、他方の支持ばね部材は延びるように作用するため、支持ばね部材の程序をびるように作用するため、支持ばね部材の程序を取るように作用するため、大方の対はないでき、板厚のバラッキによる一次共振周波数のバラッキをも少なことができ、トラッキングミラーアクチュエ

- 12 -

このヨーク絡と、ヨーク7の他端値に固定された 磁石8とによって形成される磁気ギャップ9の中 に上記範動コイル4の一辺が位置していることに なる。

上記支持ばね部材15は、可動部1の両個に左右対称に設けられており、この可動部1両側の支持ばね部材15は、夫々同一直線Cを中心にねじれるねじりばね部20と、直線Cの方向に届曲する組曲部21とを有する構造となっている。

ここで、ねじりばね節20は、直線C上に中心線を有する存板状のばねよりなり、一箱を可動部1のミラー支持部材3に、他箱を、支持ばね部材15の風曲部21頃に固定されている。また、風曲部21は、直線Cに垂直な暫と、直線Cに平行な面とを有し、直線Cの方向に風曲可能に形成されており、ねじりばね都20の一端を、固定部支持体6に対して直線Cの方向に移動可能に支持している。

機、可動部1の重心は、直線Cの近傍に位置し、 この直線Cは可動部1の回転中心となる。 さて、第1回、第2回に示す構成のトラッキングミラーアクチュエータ装置において、磁気ギャップ8の中の駆動コイル4に発生するミラースイルで反対となるように各駆動コイル4に流れる電流の向きを決定することにより、可動部1には低の的に低力が発生し、可動部1は直線でを中心に回動される。したがって、可動部1の回動方向をトラッキングエラー信号によって制御することにより所定のトラッキング動作が行われる。

ところで、このトラッキング動作時に、支持ばれ部材15のねじりばね部20にはねじり変形が生じ、ねじりばね部20は長手方向(図中ッ方向)に若干給まるが、ねじりばね部20は、上述したように、屈曲部21により一端側が直線で(回転中心軸)方向に移動可能に支持されているため、このときのばね定数は、一般的な片持ちのねじりばねとほぼ同等となる。このため、支持ばね部材15のねじりばね都20の板厚は、従来の両韓国定の時に比べて十分厚くすることができ、被厚の

- 15 -

ばね部材15の風曲部21はy方向の配性が小さくなっているため、可動部1にはy方向の底造運動及びz頼回りの回転運動が発生しやすいが、何れもミラー2の反射面内の運動であるので、ミラー2で反射された光束の位置及び角度への影響はない。

次に、第5回は本発明の第2の構成の一実施例 を示すトラッキングミラーアクチュエータ装置の 製視構成図である。

第5回において、このトラッキングミラーアクチュエータ装置の可動部1は、ミラー2とミラー 文持体3と2つの原動コイル4とから構成されており、この可動部1の構造は第1回乃至第4回で 説明した第1の構成のものと同一である。

上記可動部1の左右両側を失々支持する2つの 支持ばね部材25は、夫々の中心線が同一直線C 上にある模板よりなり、直線Cを中心に微小角ね じれた形で、一端側を可動部1のミラー支持体3 に、他端側を基台10側の固定部支持体6に固定 されている。ここで、第6週は上記支持ばね部材

- 17 -

バラツキによる一次共協園放敷のバランキは十分 小さくなる。

次に、第3回及び第4回に本発明の第1の標成のトラッキングミラーアクチュエータ装置の第2の実施例を示す。ここで、第3回はトラッキングミラーアクチュエータ装置の斜視構成図、第4回(a)は同上トラッキングミラーアクチュエータ装置の支持ばね部材を図中ェ方向より見た状態を模式的に示す平面視図、第4回(b)は第4回(a)のIV-IV線節面視図である。

第3回、第4回において、この実施例におけるトラッキングミラーアクチュエータ装置の構造は第1の実施例と喧同一であるが、本実施例では、支持ばね部材15としてL字状の薄板を用い、ねじりばね部20と屈歯部21とを単一の板ばねにより形成した例である。このようにねじりばね部20と屈曲部21とを単一の板ばねにより形成した場合には、部品点数の削減、組立作業の簡単化が図れる。

尚、上述の第1、第2の実施例において、支持

- 16 -

25の固定館の状態を示す図、第7図は上記文特はね部材25の固定後の状態を失々模式的に示す 図であり、可動部1両側の夫々の文特はね部材2 5は岡一方向にねじれた状態で固定されている。

尚、可動部1の望心は底線Cの近傍に位置し、 この底線Cが可動部1の回転中心となる。

さて、第5回に示す構成のトラッキングミラーアクチュエータ装置において、磁気ギャップ8の中の駆動コイル4に発生するミラー法線方向(図中ェ方向)の力の向きが、夫々のコイルで反対となるように認動コイル4に流す電流の向きを決定することにより、可動部1には磁気的に偶力がもしたがって、トラッキングまではない向き大きさを制御し、可動部1の回動を制御することにより所定のトラッキング動作が行われる。

ところで、このトラッキング動作時には、支持 ばね部材25には可動部1の回動に応じてねじれ が生じ、一方の支持ばね部材25は予め与えられ ているねじれが増す方向にねじれ、他方側の支持ばれ部材25は予め与えられているねじれが減る方向にねじれる。このため、一方の支持ばね部材25は長手方向(図中y方向)に若干艙なり、に若干艙なり、に若干的ではないなる。このため、支持ばれ部材25にからですが強いない。支持ばれるのときと同等となる。したがって、支持ばな部材25の被厚は性来装置に比べって、支持ばな部材25の被厚は性来装置に比べって、大分厚くすることが可能となる。

ところで、以上のような構成で問題となるのは、 支持ばね部材25は予めねじられた状態から、さ 6にトラッキングに必要な角度だけねじられた状 態となるため、支持ばね部材25に値く剪断応力 (kgf/d)が大きくなるということである。

そこで、支持ばね部材25の剪斯応力(kgf/ d)が許容応力を越える危険がある場合は、支持 ばね部材25は平坦な薄板にねじりを加えた状態

- 19 -

ばね部の一幅を上記回転中心軸方向に移動可能に 支持する屈曲部とで構成したので、上記ねじりば ね部の板厚を厚くしても一次共振周波数を十分低 くすることができ、且つ、板厚のバラツキによる 一次共振周波数のパラツキをも小さくすることが できる。

また、上記第1の構成のトラッキングミラーアクチュエータ装置において、支持ばね部材のねじりばね部と届曲部を単一の根ばねにより形成した場合には、部品点数の削減及び組立て作業の簡単

次に、本発明による第2の根成のトラッキング ミラーアクチュエータ装置においては、可動部の回転 両側部を支持する支持ばね部材を、可動部の回転 中心報を中心に失々同方向に微小角ねじりを加え た状態で固定したため、支持ばね部材のばね定数 は、支持ばね部材の一端が回転中心軸方向に移動 可能な場合と同等となり、支持ばね部材の板厚を 厚くしても一次共級周被数を十分低くすることが でき、且つ、板厚のパラツキによる一次共級周波 で固定するのではなく、予め、微小量ねじれた状態に形成しておけばよい。すなわち、ねじり力が働かない状態において、微小量のねじれを持つ容板を製作し、支持ばね部材25として使用すればよく、この 合には、トラッキング動作により支持ばね部材25に係く貧雨応力は第8回に示した

尚、以上の突放例において、支持ばね部材25 に与えられるねじれ角は、トラッキングに必要な 回転角以上であれば本発明の効果は得られ、この 角度は大変微小な角度である。したがって、本実 施例の場合も、支持ばね部材25の2方向及びy 方向の剛性は従来装置の場合と同等と考えられ、 2方向及びy方向への無用の扱動が防止できる。 (発明の効果)

以上、実施例に基づいて説明したように、本発明による第1の構成のトラッキングミラーアクチュエータ装置においては、可動部の両便部を支持する一対の支持ばね部材を、可動部の回転中心軸を中心にねじれ変形するねじりばね部と、ねじり

- 20 -

数のパラツキをも小さくすることができる。

また、第2の構成のトラッキングミラーアクチュエータ装置において、可動部の両側部を支持する支持ばね部材として、可動部の回転中心輸を中心に央々両方向に微小角ねじれた状態に予め整形された薄板を用いた場合には、ばね定数は、支持ばね部材の一輪が回転中心輸方向に移動可能な合と同等となり、支持ばね配材の板厚を厚くしても一次共振周波数を十分低くすることができ、且つ、支持ばねに働く英断応力を増加させることなく板厚のパラツキによる一次共銀周波数のパラツキを小さくすることができる。

### 図面の簡単な説明

第1回は本発明の第1の構成の一実施例を示す トラッキングミラーアクチュエータ装置の斜視構成図、第2回(a)は同上トラッキングミラーアクチュエータ装置の支持ばれ部材を図中ェ方向より見た状態を模式的に示す平面図、第2回(b) は第2回(a)のⅡーⅡ線断面図、第3図は本発明の第1の 成の別の実施例を示すトラッキング

ミラーアクチュエータ装置の斜視 成図、第4図 (a) は同上トラッキングミラーアクチュエータ 装置の支持ばね部材を図中ェ方向より見た状態を 模式的に示す平面図、第4図(b)は第4図(a) のIV-IV線斯面図、第5図本発明の第2の 成の 一実施例を示すトラッキングミラーアクチュエー タ装置の斜視構成図、第6図は何上トラッキング ミラーアクチュエータ装置の支持ばね部材の固定 前の状態を示す説明図であって、同図(a)は文 持ばね部材を第5回ッ方向から見たときの図、同 図(b) は支持ばね部材を第5図×方向から見た ときの図、第7図は第5図に示すトラッキングミ ラーアクチュエータ装置の支持ばね部材の固定後 の状態を示す説明図であって、同図(a)は支持 ばね部材を第5回ッ方向から見たときの図、同図 (b) は支持ばね部材を第5回×方向から見たと きの図、第8図は従来技術の一例を示すトラッキ ングミラーアクチュエータ装置の斜視梯成図、第 9図 (a) は関上従来のトラッキングミラーアク チュエータ装置の支持ばね部材を図中×方向より

見た状態を模式的に示す平面図、第9図(b)は 第9図(a)の区一区線断面図である。

1 ···· 可動部、2 ···· ミラー、3 ···· ミラー支持体、4 ···・ 配動コイル、1 S, 2 5 ···・ 支持ばね部材、6 ··・・ 固定部支持体、7 ···・ ヨーク、8 ·
··・ 磁石、9 ··・・ 磁気ギャップ、10 ··・・ 基台、20 ··・・ ねじりばね部、21 ··・・ 届曲部、C ··・・ 回転中心線。

代理人 樺山 (他1名)

- 23 -

- 24 -

# 売 イ 図

